



NJCX

iCDMet

Advancing Auto CD and Roughness

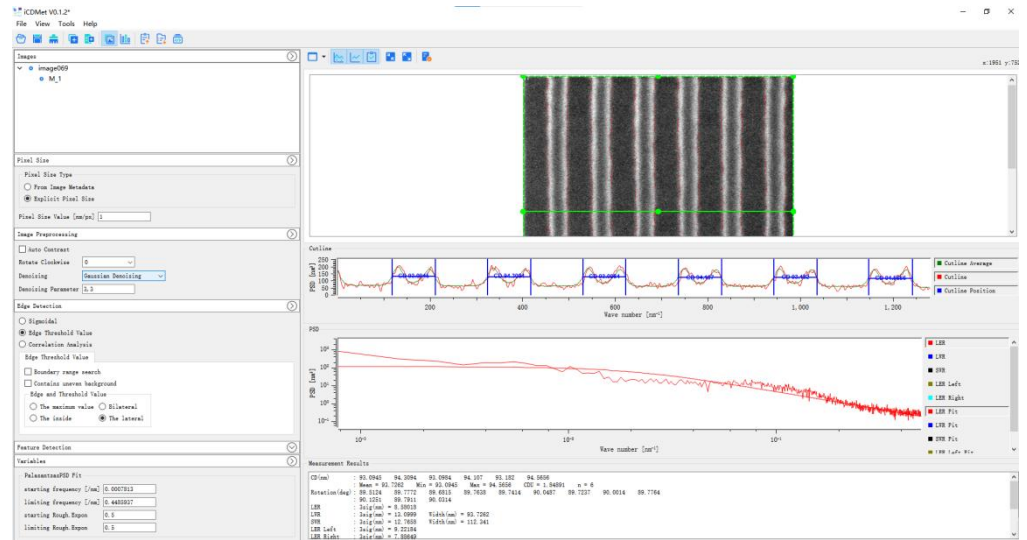
Metrology Software for R&D



iCDMet

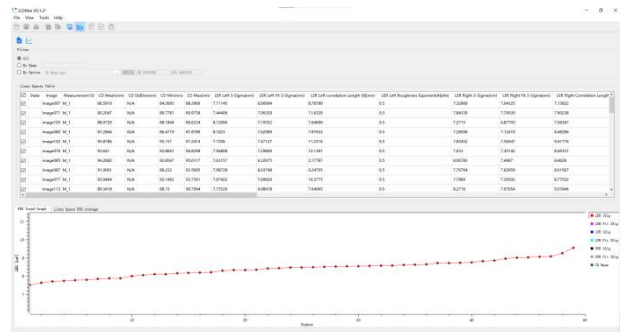
Advancing CD and Roughness Metrology for R&D

iCDMet 致力于为企业、高校和研究机构提供自动化的测量与表征功能，能够实现高精度的线宽测量和粗糙度计算。同时，能够根据客户需求定制组件和功能，以满足多样化的需求。



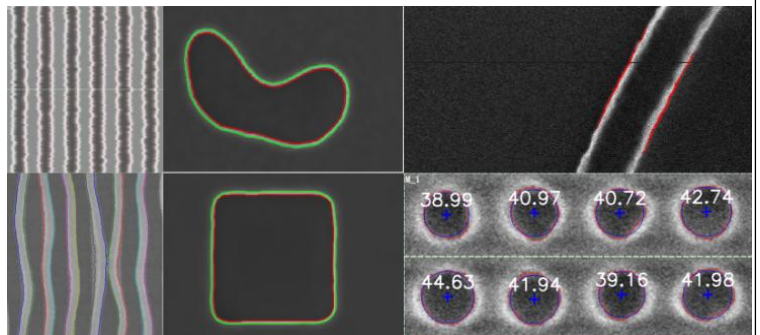
iCDMet 支持从微米到纳米特征尺寸的精确测量，主要功能包括：

- 多种边缘识别算法
- 线宽测量、间隙测量、直径测量
- Line & Space、Hole 的边缘粗糙度和宽度粗糙度分析
- 频域分析对比
- Hole 阵列处理
- 2D 阵列处理
- 高效批量处理
- 功率谱密度计算和拟合



可精准分析的特征结构包括：

- 规则线条结构（俯视图）
- 扭曲结构
- Hole 结构
- 2D 结构
- 比例尺
- 曲线掩模结构
- 其他自定义结构





iCDMet

Advancing CD and Roughness
Metrology for R&D

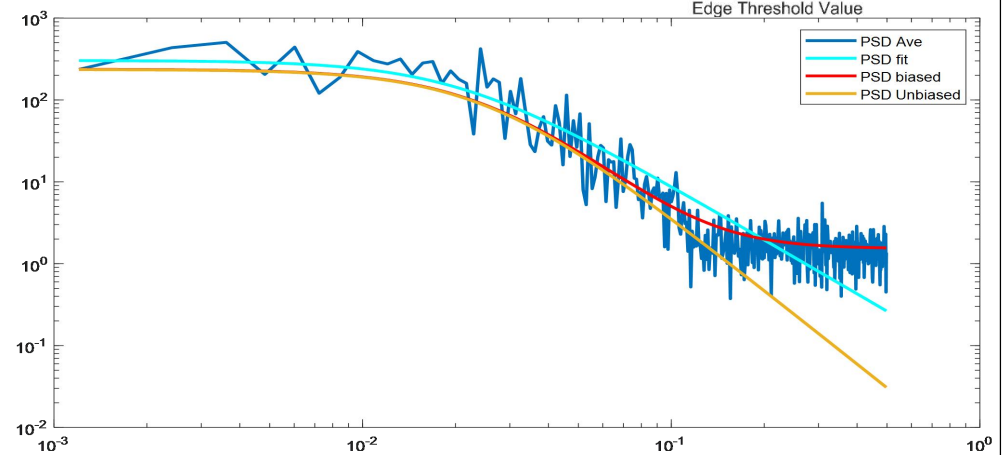
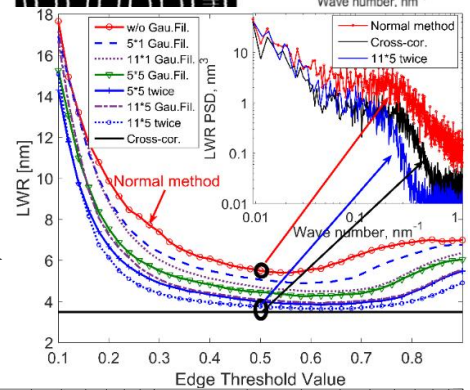
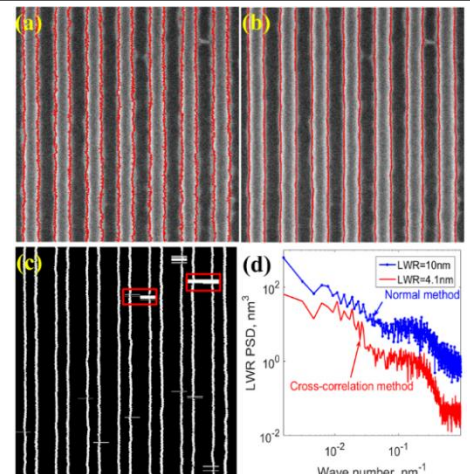
iCDMet 致力于为企业、高校和研究机构提供自动化的测量与表征功能，能够实现高精度的线宽测量和粗糙度计算。同时，能够根据客户需求定制组件和功能，以满足多样化的需求。

所具备的边缘识别算法包括：

- ✓ 像素阈值算法
- ✓ 最大斜率算法
- ✓ 相关分析算法
- ✓ 背景强二次电子溢出

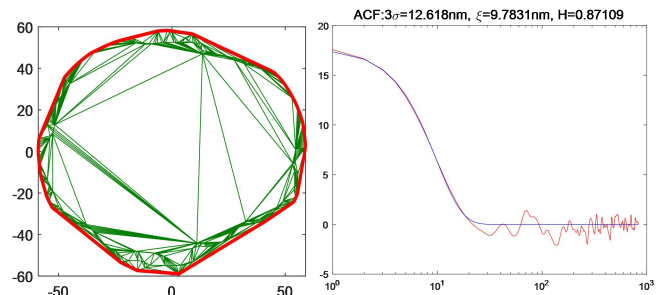
功率谱密度方法包括：

- ✓ 基于边缘数据的分析
- ✓ ACF & HHCF 拟合
- ✓ Palasantzas PSD 拟合
- ✓ PSD Biased & PSD Unbiased 拟合
- ✓ 中低高频域阈值连续扫描



客户自定义功能：

- ✓ 缺陷定位
- ✓ 圆形度分析
- ✓ 平均 PSD 分析
- ✓ 去噪算法的对比研究
- ✓ 用于 PWA 的 FEM 处理
- ✓ 边缘轮廓导出成 GDS





NJCX

iCDMet

Advancing CD and Roughness
Metrology for R&D